

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
9. Juni 2005 (09.06.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/053012 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H01L 21/60**,
21/288

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/052999

(22) Internationales Anmeldedatum:
17. November 2004 (17.11.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 55 953.1 29. November 2003 (29.11.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **INFINEON TECHNOLOGIES AG** [DE/DE]; St.-
Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **HELNEDER, Johann**
[DE/DE]; Fasanenweg 5, 85652 Landsham (DE). **TOR-**
WESTEN, Holger [DE/DE]; Josef-Kyrein-Str. 4 A, 85579
Neubiberg (DE).

(74) Anwälte: **KARL, Frank** usw.; Patentanwälte Kinder-
mann, Postfach 1330, 85627 Grasbrunn (DE).

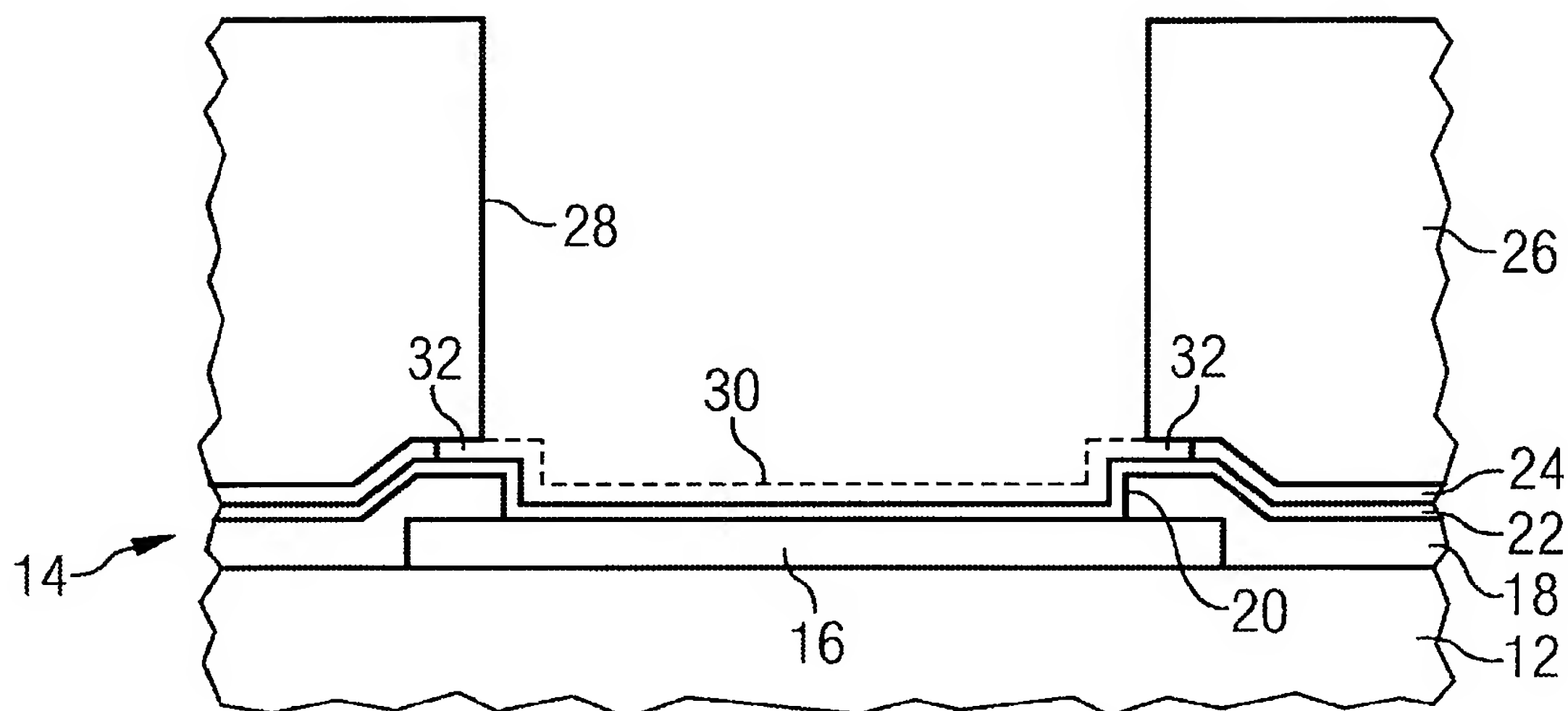
(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL,
PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR GALVANISING AND FORMING A CONTACT BOSS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM GALVANISIEREN UND KONTAKTVORSPRUNGSANORDNUNG



(57) Abstract: The invention relates inter alia to a method for galvanising consisting, for example in structuring a copper layer (24) by means of a resist (26). A barrier layer (22) placed under said copper layer (24) is used for supplying a galvanisation current to the areas without the copper layer. The inventive method makes it possible to produce high quality soldering bumps.

(57) Zusammenfassung: Erläutert wird unter anderem ein Verfahren zum Galvanisieren, bei dem bspw. eine Kupferschicht (24) unter Verwendung eines Resists (26) strukturiert wird. Eine unter der Kupferschicht (24) liegende Barrierschicht (22) wird in Bereichen ohne Kupferschicht zum Heranführen des Galvanisierungsstroms verwendet. Mit dem Verfahren lassen sich Lötbumps hoher Qualität herstellen.

WO 2005/053012 A1



Veröffentlicht:

— *mit internationalem Recherchenbericht*

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Beschreibung

Verfahren zum Galvanisieren und Kontaktvorsprungsanordnung

- 5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Galvanisieren, bei dem die folgenden Schritte ausgeführt werden:
- Aufbringen einer elektrisch leitfähigen Grundsicht auf ein Substrat,
 - Aufbringen einer im Vergleich zu der Grundsicht besser
 - 10 elektrisch leitenden Hilfsschicht nach dem Aufbringen der Grundsicht,
 - Aufbringen einer Maskenschicht nach dem Aufbringen der Hilfsschicht, z.B. einer Resistschicht,
 - Erzeugen einer Maske mit mindestens einer Maskenöffnung aus
 - 15 der Maskenschicht,
 - Galvanisieren einer Schicht in der Maskenöffnung.

Das Substrat ist beispielsweise ein Halbleitersubstrat mit einer Metallisierungslage oder mit mehreren Metallisierungslagen. Häufig werden Silizium-Halbleitersubstrate eingesetzt.

20 Die Metallisierung enthält beispielsweise mehr als achtzig Atomprozent Aluminium oder mehr als achtzig Atomprozent Kupfer.

- 25 Die elektrisch leitfähige Grundsicht ist bspw. eine Haftvermittlungsschicht zur Erhöhung der mechanischen Haftung und/oder eine Diffusionsbarriereschicht zur Verhinderung der Diffusion. Beispielsweise werden Titannitridschichten als Kupferbarriereschichten verwendet. Im Zusammenhang mit einem
- 30 Kontaktvorsprung wird die Grundsicht und Hilfsschicht in der Fachsprache auch als "Under Bump Metallization" (UBM) bezeichnet.

Kupfer ist ein sehr preiswertes Material mit einer hohen

35 elektrischen Leitfähigkeit. Somit eignet sich eine Kupferschicht gut zum Heranführen des Stromes beim Galvanisieren.

Deshalb ist Kupfer ein Material, das Häufig als Material für die Hilfsschicht eingesetzt wird.

Die Maskenschicht ist bspw. eine Resistschicht, die mit einem
5 fotolithografischen Verfahren strukturiert wird. In der Maskenöffnung wird bspw. ein Kontaktvorsprung aus einem lötfähigen Material galvanisch abgeschieden, der in der Fachsprache auch als "Lötbump" bezeichnet wird. Als Lötmaterial werden bspw. Zinnlegierungen verwendet, insbesondere Zinn-Blei-
10 Legierungen oder umweltverträglichere Zinn-Silber-Legierungen.

Die Grundsicht, die Hilfsschicht und die Maskenschicht werden vorzugsweise ganzflächig aufgebracht. Die Grundsicht
15 und die Hilfsschicht werden bspw. aufgesputtert.

Beim Galvanisieren wird das zu beschichtende Substrat in ein Elektrolytbad eingetaucht und als Kathode geschaltet. Auf Grund der durch die Spannung hervorgerufenen elektrochemischen Vorgänge scheidet sich Material – die sog. Kationen –
20 aus dem Elektrolyten auf dem Substrat ab. Optionale Zusätze im Elektrolytbad ermöglichen die gezielte Beeinflussung bestimmter Eigenschaften der abgeschiedenen Schicht.

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein verbessertes Verfahren zum Galvanisieren anzugeben, mit dem sich insbesondere Kontaktvorsprünge mit guten mechanischen und elektrischen Eigenschaften Herstellen lassen. Außerdem soll ein Kontaktvorsprung angegeben werden, der gute mechanische und elektrische
30 Eigenschaften besitzt.

Die auf das Verfahren bezogene Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Verfahrensschritten gelöst. Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen angegeben.
35

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren werden zusätzlich zu den eingangs genannten Verfahrensschritten die folgenden Schritte ausgeführt:

- Strukturieren der Hilfsschicht unter Verwendung der Maske bzw. Resistmaske, wobei die Grundsicht nicht oder nicht vollständig gemäß der Resistmaske strukturiert wird,
- Galvanisieren einer Schicht in der Resistöffnung nach dem Strukturieren der Hilfsschicht.

Die Erfindung geht von der Überlegung aus, dass die Hilfsschicht einerseits für ein schnelles Galvanisieren mit homogenem Schichtwachstum erforderlich ist. Andererseits sind Reste der Hilfsschicht unter der abgeschiedenen Schicht oft störend, bspw. hinsichtlich von Korrosion oder hinsichtlich der Bildung bestimmter Grenzflächen. Deshalb wird die Hilfsschicht bei dem erfindungsgemäßen Verfahren mit einer ohnehin für das Festlegen des Galvanisierungsgebietes erforderlichen Maske unterhalb einer Resistöffnung entfernt. Dabei wird jedoch die Grundsicht unterhalb der Resistöffnung nicht mit entfernt. Die Grundsicht ist ebenfalls elektrisch leitfähig und damit zum Stromtransport beim Galvanisieren geeignet.

Die geringere Stromtragfähigkeit der Grundsicht fällt nicht so stark ins Gewicht, da die Hilfsschicht bis an die Maskenöffnung heran vorhanden ist und zum Stromtransport genutzt wird. In dem im Vergleich zur Substratoberfläche vergleichsweise kleinen Galvanisierungsgebiet wird die Stromtragfähigkeit mit zunehmender Dicke der abgeschiedenen Schicht erhöht. Bspw. hat das Galvanisierungsgebiet eine Fläche kleiner 40 Prozent oder kleiner 20 Prozent der Substratoberfläche.

Durch das erfindungsgemäße Verfahren lassen sich neue Schichtfolgen galvanisch abscheiden, weil Beschränkungen durch die Hilfsschicht umgangen werden. Damit lassen sich insbesondere Kontaktvorsprünge mit guten elektrischen Eigenschaften, insbesondere mit hoher Beständigkeit gegen Elektromigration, und mit einer hohen mechanischen Haftung herstel-

len. Die Kontaktvorsprünge sind insbesondere für die Flip-Chip-Technik bzw. für die Plättchenschnellmontagetechnik geeignet, bei der eine Vielzahl von Verbindungen gleichzeitig durch Löten, durch Mikroschweißen oder durch Kleben mit Leitklebstoff oder mit Leidlack hergestellt werden.

Bei einer Weiterbildung werden die folgenden Schritte ausgeführt:

- Galvanisieren mit einer Anfangs-Stromdichte in einer Anfangsphase,
- Galvanisieren mit einer im Vergleich zu der Stromdichte während der Anfangsphase höheren Haupt-Stromdichte in einer der Anfangsphase folgenden Hauptphase.

Durch diese Vorgehensweise wird der geringeren Stromtragfähigkeit der Grundsicht Rechnung getragen, weil in der Anfangsphase mit einer vergleichsweise geringen Stromdichte eine Schicht mit einer größeren elektrischen Leitfähigkeit als die Grundsicht am Boden der die Hilfsschicht durchdringenden Öffnungen abgeschieden wird. Erst wenn diese Schicht bspw. eine der Dicke der Hilfsschicht entsprechende Leitfähigkeit (z.B. größere Schichtdicke) besitzt, d.h. die Hilfsschicht ist mit einem anderen Material wieder "repariert" worden, wird die Stromdichte auf den hohen Wert erhöht, um schnell zu Galvanisieren.

Bei einer Weiterbildung beträgt die Stromdichte in der Anfangsphase weniger als 50 Prozent der Stromdichte in der Hauptphase. Die Anfangsphase ist länger als fünf Sekunden und kürzer als fünf Minuten. Der Übergang von der Anfangsphase zur Hauptphase erfolgt bei einer Ausgestaltung mit gleichmäßigem Stromanstieg über die Zeit. Bei einer anderen Ausgestaltung wird gemäß einer Stufenfolge die Stromdichte mehrfach erhöht, wobei zwischenzeitlich gleich bleibende Stromdichten verwendet werden. Auch eine Überlagerung dieser Stromdichtefunktionen mit Stromimpulsen wird durchgeführt.

Bei einer Weiterbildung ist die Stromdichte in der Hauptphase größer als 0,2 Ampere pro Quadratdezimeter und kleiner als 10 Ampere pro Quadratdezimeter (ASD Ampere per square decimeter), bspw. bei 0,5 A/cm². Die genannten Stromdichtewerte
5 beziehen sich auf die geöffnete Resistfläche auf der Waferoberfläche.

Bei einer nächsten Weiterbildung werden die folgenden Schritte ausgeführt:

- Aufbringen einer Isolierschicht vor dem Aufbringen der
10 Grundsicht,
- Strukturieren der Isolierschicht unter Erzeugen einer Kontaktöffnung vor dem Aufbringen der Grundsicht.

Die Isolierschicht ist im Fall eines Kontaktvorsprungs bspw. eine Passivierungsschicht die bspw. eine Siliziumoxidschicht
15 und/oder eine Siliziumnitridschicht enthält. Die Kontaktöffnung liegt unterhalb der Maskenöffnung für das Galvanisieren. Wird die Maskenöffnung etwas breiter gewählt als die Kontaktöffnung, so ist das Entfernen der Reste der bereits vorstrukturierten Hilfsschicht und der außerhalb der zu erzeugenden
20 Anordnung liegenden Teile der Grundsicht erleichtert, da die Isolierschicht als Ätzstoppschicht genutzt wird.

Bei einer nächsten Weiterbildung ist die Grundsicht eine Barrierschicht gegen Kupferdiffusion. Die Hilfsschicht ent-
25 hält Kupfer oder besteht aus Kupfer und ist somit zum Zuführen des Galvanisierungsstroms besonders gut geeignet. Jedoch ist Kupfer auch ein Material, dass bei Feuchtigkeit besonders korrosiv ist, da besonders leicht Mischoxide entstehen, die auch als Grünspan bezeichnet werden. Diese Mischoxide verringern die Haftung der Schichten in der zu erzeugenden Anord-
30 nung erheblich. Auch die Stromleitfähigkeit während des Betriebs der integrierten Schaltungsanordnung würde somit erheblich verringert werden. Da die Hilfsschicht vollständig entfernt wird, insbesondere in dem Bereich, in dem die
35 Schicht galvanisch abgeschieden wird bzw. in dem die Schichten galvanisch abgeschieden werden, kommen diese Nachteile nicht zum Tragen, insbesondere wenn die Anordnung auch im

Übrigen kupferfrei ist. Insbesondere sind auch keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich, um kupferhaltige Schichten einzukapseln und so vor Feuchtigkeit zu schützen.

5 Bei einer anderen Weiterbildung werden die folgenden Schritte durchgeführt:

- Galvanisieren einer Sockelschicht,
 - Galvanisieren einer Deckschicht nach dem Galvanisieren der Sockelschicht, wobei die Sockelschicht aus einem anderen
- 10 Material besteht als die Deckschicht.

Somit wird ein Schichtstapel abgeschieden, der es erlaubt Kombinationswirkungen zu erzielen, bspw. die Bildung bestimmter Verbindungen bei einem nachfolgenden Reflowprozess oder die Verbesserung von mechanischen Eigenschaften der zu erzeugenden Anordnung.

15

Bei einer Weiterbildung hat das Material der Sockelschicht einen Schmelzpunkt größer 500 Grad Celsius und ist damit lötbeständig. Das Material der Deckschicht hat einen Schmelz-

20 punkt kleiner 400 Grad Celsius und ist damit lötfähig.

Die Erfindung betrifft außerdem eine Kontaktvorsprungsanordnung, die auch als Lötbump bezeichnet wird. Der Lötbump enthält in der folgenden Reihenfolge mit zunehmenden Abstand zu einem Substrat eines integrierten Schaltkreises:

- 25 - eine elektrisch leitfähige Leitbahn zum lateralen Stromtransport oder eine Anschlussplatte, die auch als Anschlusspad bezeichnet wird und zum vertikalen Stromtransport dient, d.h. in einer Richtung genau entgegen zu einer Normalenrichtung einer Substrathauptfläche,
- 30 - eine elektrisch leitfähige Grundsicht, insbesondere eine Haftvermittlungs- und Barrierenschicht,
- angrenzend an die Grundsicht eine kupferfreie Sockelschicht aus einem Material mit einer Schmelztemperatur größer 500 Grad Celsius,
- 35 - vorzugsweise angrenzend an die Sockelschicht eine elektrisch leitfähige Lotmaterialsicht mit einem Schmelzpunkt kleiner 400 Grad Celsius.

Die erfindungsgemäße Kontaktvorsprungsanordnung lässt sich besonders gut mit dem erfindungsgemäßen Verfahren oder einer seiner Weiterbildungen herstellen. Insbesondere kann eine
5 kupferfreie Kontaktvorsprungsanordnung unter Verwendung einer Kupferhilfsschicht beim Galvanisieren hergestellt werden.

Bei einer Weiterbildung enthält die Sockelschicht mindestens 60 Atomprozent Nickel. Bspw. besteht die Sockelschicht aus
10 Nickel, Nickelphosphor oder Nickelchrom. Nickel bildet mit dem Lotmaterial, z.B. dem Zinn-Silber in einer Grenzsicht eine ternäre bzw. Dreifach-Verbindung, wobei die Dicke der Grenzsicht durch Selbstregulierung beim Bilden der ternären Verbindungen begrenzt wird. Zusätzliche Maßnahmen zum Festle-
15 gen der Dicke der Grenzsicht sind also nicht erforderlich. Die Grenzsicht bildet eine wirksame Barriere gegen Elektromigration und erhöht andererseits den elektrischen Widerstand nur in einem noch hinnehmbaren Maß. Die ternären Verbindungen bauen bspw. als intermetallische Phasen ein kompliziertes
20 Raumgitter auf.

Die Leitbahn bzw. die Anschlussplatte besteht bei einer Weiterbildung aus mindestens 80 Atomprozent Aluminium. Alternativ wird jedoch Kupfer als Bestandteil eingesetzt, dessen
25 Anteil bei mehr als 50 Atomprozent liegt.

Bei einer Weiterbildung bildet die Grundsicht eine Diffusionssperre für Kupfer, so dass das Kupfer der Hilfsschicht nicht in die Leitbahn dringt. Bei einer Weiterbildung besteht
30 die Grundsicht aus Titanwolfram bzw. enthält Titanwolfram, wobei der Titananteil vorzugsweise kleiner als 20 Atomprozent ist. Die Barrieren- und Haftungseigenschaften dieser Schicht sind besonders gut. Jedoch sind auch andere Materialien geeignet, wie Titan, Tantal, Titannitrid oder Tantalnitrid und
35 weiterhin sind auch Schichtkombinationen dieser Materialien möglich, z.B. eine Schichtfolge aus einer Titanschicht, einer Titanwolframschicht und einer Titanschicht.

Grenzt die Grundsicht an die Leitbahn an, so befinden sich keine weiteren Schichten zwischen der Grundsicht und der Leitbahn, so das die Kontaktvorsprungsanordnung einen einfachen Aufbau hat. Insbesondere liegt zwischen der Leitbahn und der Grundsicht keine kupferhaltige Schicht, die vor Korrosion geschützt werden müsste.

Im Folgenden wird die Erfindung an Hand der beiliegenden Figuren erläutert. Darin zeigen:
Figuren 1A bis 1B Herstellungstufen bei der Herstellung eines Lötbumps, und
Figur 2 eine Draufsicht auf den Löt bump nach dem Abscheiden eines Nickelsockels und vor dem Abscheiden von Lotmaterial.

Figuren 1A bis 1B zeigen Herstellungstufen bei der Herstellung eines Lötbumps 10. Das Verfahren beginnt ausgehend von einem Substrat 12, das z.B. mehrere nicht dargestellte Metallisierungslagen und einen Hauptkörper aus Silizium enthält. Die Metallisierungslagen enthalten jeweils eine Vielzahl von Leitbahnen und Vias, die innerhalb einer Metallisierungslage durch ein Intralagendielektrikum und zwischen benachbarten Metallisierungslagen durch ein Interlagendielektrikum isoliert sind. Auf dem Hauptkörper aus Silizium sind eine Vielzahl von Halbleiterbauelementen ausgebildet, z.B. Feldeffekttransistoren einer Speicherschaltung oder eines Prozessors.

Wie in Figur 1A dargestellt, wird auf das Substrat 12 eine obere Aluminiumschicht 14 aufgebracht und unter Verwendung eines fotolithografischen Verfahrens strukturiert, wobei ein Anschlusspad 16 erzeugt wird. Die Aluminiumschicht 14 und auch das Anschlusspad 16 haben bspw. eine Dicke im Bereich von 500 Nanometern bis zu zwei Mikrometer, im Ausführungsbeispiel von 500 Nanometern. Das Anschlusspad 16 hat bspw. eine rechteckige oder quadratische Grundfläche. Im Ausführungsbeispiel ist die Grundfläche achteckig, wobei der Abstand zweier

einander gegenüberliegender Seiten des Sechsecks etwa 80 Mikrometer beträgt. Die Aluminiumschicht 14 enthält nur geringe Zusätze kleiner als 5 Atomprozent, bspw. 0,5 Atomprozent Silizium, und ggf. einen Kupferzusatz, z.B. 1 Atomprozent.

Nach dem Strukturieren der Aluminiumschicht 14 wird eine Passivierungsschicht 18 abgeschieden. Die Passivierungsschicht 18 hat bspw. eine Schichtdicke im Bereich von 500 Nanometern bis zu einem Mikrometer, im Ausführungsbeispiel von 500 Nanometern. Die Passivierungsschicht 18 enthält bspw. eine Oxidschicht und eine darüber liegende Nitridschicht. Mit Hilfe eines fotolithografischen Verfahrens werden in die Passivierungsschicht 18 für Lötbumps eine Vielzahl von Aussparungen eingebracht, von denen in Figur 1A eine Aussparung 20 dargestellt ist. Die Aussparung 20 ist bspw. ebenfalls achteckig, hat jedoch einen kleineren Durchmesser als das Anschlusspad 16. Im Ausführungsbeispiel beträgt der Durchmesser der Aussparung 20 etwa 60 Mikrometer.

Nach dem Erzeugen der Aussparung 20 wird ganzflächig eine Titan-Wolfram-Barriereschicht 22 aufgebracht, deren Schichtdicke bspw. im Bereich von 100 Nanometern bis zu 200 Nanometern liegt. Im Ausführungsbeispiel hat die Barriereschicht 22 eine Schichtdicke von 100 Nanometern. Die Barriereschicht 22 enthält bspw. mehr als 80 Atomprozent Wolfram. Im Ausführungsbeispiel beträgt der Wolframanteil 90 Atomprozent und der Titananteil 10 Atomprozent. Die Barriereschicht 22 wird bspw. aufgesputtert.

Nach dem Aufbringen der Barriereschicht 22 wird ganzflächig eine Kupferschicht 24 aus reinem Kupfer aufgebracht, z.B. mit einem Kupferanteil größer als 98 Atomprozent. Die Dicke der Kupferschicht 24 liegt bspw. im Bereich von 80 Nanometern bis 150 Nanometern. Im Ausführungsbeispiel hat die Kupferschicht 24 eine Dicke von 100 Nanometern. Beispielsweise wird die Kupferschicht 24 aufgesputtert.

Wie weiter in Figur 1A dargestellt ist, wird anschließend auf die Kupferschicht 24 eine Resistschicht 26 aufgebracht, z.B. mit einer Schichtdicke von 100 Mikrometern. Die Resistschicht 26 wird belichtet und entwickelt, wobei oberhalb der Aussparung 20 eine Aussparung 28 entsteht. Die Aussparung 28 ist ebenfalls achteckig, hat jedoch einen etwas größeren Durchmesser als die Aussparung 20. Der Durchmesser der Aussparung 28 beträgt im Ausführungsbeispiel 80 Mikrometer. Die Aussparungen 20 und 28 liegen konzentrisch zueinander.

Wie weiter in Figur 1A durch eine gestrichelte Linie 30 dargestellt ist, wird nach dem Entwickeln der Resistschicht 26 das Kupfer am Boden der Aussparung 28 entfernt durch Strukturieren der Kupferschicht 24 gemäß der durch die Resistschicht 26 gebildeten Maske. Es wird bspw. nasschemisch geätzt, wobei Unterätzungen 32 der Kupferschicht 32 unkritisch sind, wie im Folgenden noch näher erläutert wird. Bei einem anderen Ausführungsbeispiel werden die Unterätzungen auf Grund einer Optimierung der Ätzung gering gehalten und betragen weniger als 2 Mikrometer.

Wie in Figur 1B gezeigt, wird anschließend ein Nickelsockel 50 galvanisch abgeschieden, wobei außerhalb der Aussparung 28 die Kupferschicht 24 maßgeblich zur Stromführung dient. Nur am Boden der Aussparung 28 dient die Barrierschicht 20 maßgeblich zur Stromzuführung, insbesondere am Anfang des Galvanisierens. Bspw. wird gemäß der oben angegebenen Galvanisierverfahren zunächst nur mit einer geringen Stromdichte vergleichsweise langsam galvanisiert. Hat dann der Nickelsockel 50 eine Schichtdicke wie die Kupferschicht 24, d.h. im Ausführungsbeispiel eine Schichtdicke von 100 Nanometern, so wird allmählich oder stufenweise auf eine höhere Stromdichte für ein schnelleres Galvanisieren umgeschaltet. Der Nickelsockel 50 wird bspw. mit einer Schichtdicke von zwei Mikrometern bis fünf Mikrometern abgeschieden. Im Ausführungsbei-

spiel beträgt die Schichtdicke des Nickelsockels drei Mikrometer.

5 Beim Abscheiden des Nickelsockels 50 stören die Unterätzungen 32 bzw. diese Hohlräume nicht, weil eventuelle Abscheidungen in diesem Bereich keine negativen Auswirkungen auf die Funktionalität des Kontaktvorsprungs haben.

10 Wie weiter in Figur 1B gezeigt, wird anschließend Lotmaterial 52 galvanisch abgeschieden, wobei gleich zu Beginn eine hohe Stromdichte verwendet wird. Das Lotmaterial ist im Ausführungsbeispiel eine Zinn-Silber-Legierung, die mit einer Schichtdicke im Bereich von 50 bis 120 Mikrometern abgeschieden wird. Im Ausführungsbeispiel hat das Lotmaterial 52 eine
15 Schichtdicke von 90 Mikrometern.

Die galvanischen Abscheidungen des Nickelsockels 50 und des Lötmaterials 52 sind konform. Eine Kante 54 der Aussparung 20 wird als Kante 56 am Nickelsockel 50 und als Kante 58 am
20 Lotmaterial 52 abgebildet.

Figur 1C zeigt, dass nach dem Abscheiden des Lotmaterials 52 die Resistschicht 26 wieder entfernt wird, so dass der Löt-
bump 10 frei liegt. Nasschemisch oder trockenchemisch werden
25 anschließend die Reste der Kupferschicht 24 von der Barrierschicht 22 entfernt. Danach aber gegebenenfalls mit dem gleichen Ätzverfahren wird die Barrierschicht 22 in Bereichen entfernt, die nicht vom Nickelsockel 50 bedeckt sind. Es entsteht ein Barrierschichtbereich 22a zwischen dem Nickel-
30 sockel 50 und dem Anschlusspad 16. Der Barrierschichtbereich 22a ragt über die Aussparung 20 hinaus und liegt auf der Passivierungsschicht 18 in der Nachbarschaft der Aussparung 22a auf, bspw. in einer Nachbarschaft kleiner als 15 Mikrometer. Weiter entfernt von der Aussparung 20 wurde die Barriere-
35 reschicht 22 dagegen entfernt.

Mit Hinblick auf das Entfernen der Kupferschicht 24 und der Barrierschicht 22 werden möglichst kleine Schichtdicken für die Kupferschicht 24 und für die Barrierschicht 22 gewählt, ohne jedoch deren eigentliche Stromzufuhrfunktion bzw. Barrierefunktion zu stark zu beeinträchtigen.

Der Löt bump 10 wird anschließend in einem Reflow-Schritt kurzzeitig auf eine Temperatur von bspw. 400 Grad Celsius erwärmt, wobei sich das Lotmaterial 52 kugelförmig umformt.

10 An der Grenze 70 von Nickelsockel und Lotmaterial bildet sich eine dünne Grenzsicht, die u.a. die ternäre Legierung Zinn-Nickel-Silber enthält.

Figur 2 zeigt eine Draufsicht auf den Löt bump 10 nach dem Abscheiden des Nickelsockels 50 und vor dem Abscheiden des Lotmaterials 52. Die Draufsicht wurde ursprünglich fotografiert, wobei die Resistschicht 26 vorher entfernt worden ist. Gut zu erkennen ist das achteckige Anschlusspad 16, das bspw. an eine Leitbahn 80 einer Umverdrahtungsebene angrenzt. Die Titanwolfram-Barrierschicht 22 liegt im Bereich der Unterätzungen 32 frei, die bspw. in Umfangsrichtung eine Breite B1 von bis zu 10 Mikrometern haben.

Der Nickelsockel 50 wird durch die Aussparung 28 begrenzt und hat einen Durchmesser D von 80 Mikrometern. Gut zu erkennen ist auch die Kante 56 des Nickelsockels 50.

Zusammenfassend gilt, dass die Hilfsschicht, insbesondere die Kupferschicht, in den Kontaktfenstern selektiv entfernt wird, insbesondere durch nasschemisches oder galvanisches Rückätzen, was auch als Deplating bezeichnet wird. Beim galvanischen Rückätzen wird das Substrat als Anode geschaltet, von der Material abgetragen wird. Der rückgearbeitete Bereich wird anschließend durch eine elektrochemische Abscheidung, z.B. eine Nickelabscheidung, wieder aufgebaut. Somit liegen insbesondere kupferfreie Grenzflächen unter den Löt bumps vor. Es ergeben sich die folgenden technischen Wirkungen:

- starke störende metallische Phasenbildungen, z.B. von Kupfer und Zinn, treten nicht mehr auf,
- nach dem Lackentfernen kann somit unter Umständen die UBM (Under Bump Metallization) in einem einzigen Ätzschritt entfernt werden. Diese Ätzung ist auf das Entfernen der Barriere, z.B. Titan oder Titanwolfram, optimiert. Die Hilfsschicht und die Barriereschicht werden vorzugsweise in derselben Ätzkammer entfernt, insbesondere mit der gleichen Ätzchemikalie bzw. Ätzchemikalienzusammensetzung.
- 10 - die Unterätzung des Lötbumps ist minimiert.
- zum Entfernen der Hilfsschicht in den Kontaktfenstern lässt sich auch dieselbe Elektroplating Anlage einsetzen wie beim Abscheiden innerhalb der Maskenöffnung ohne dass das Substrat zwischenzeitlich aus der Anlage genommen wird,
- 15 - ein Plating, bspw. ein Nickelplating, direkt auf die Barriereschicht wird möglich,

Ein bevorzugtes Anwendungsgebiet sind Hochfrequenzschaltungen und Gehäuse mit mehr als 100 Anschlüssen, die gemäß der Flip-Chip-Technik montiert werden. Vor dem elektrochemischen Abscheiden von Lotkugeln bzw. Lötbumps werden als ganzflächige Elektrode auf dem Wafer eine Metallbarriere, z.B. eine Titanschicht oder eine Titanwolframschicht, und eine Hilfsschicht aufgebracht, z.B. eine Kupferschicht. Diese beiden Schichten können als UBM (Under Bump Metallization) angesehen werden und sind bspw. durch Magnetronspotten oder Elektronenstrahldampfen aufgebracht.

Die Barriereschicht verhindert metallische Interdiffusion vom Lotmaterial in die Leitbahnen auf dem Wafer. Die Hilfsschicht dient als stromtragende Kontaktierungsschicht für den Elektroplating-Prozess.

Nach der Lithografie stehen geöffnete Lack-Kontaktfenster bereit zum Auffüllen mit Bump-Metallisierungen. Der Elektroplating-Prozess beginnt mit einem Benetzungs- bzw. Prewetting-Schritt zum gleichmäßigen Benetzen der Kontakte mit dem

Elektrolyten. Als erste Metallschicht soll bspw. Nickel aufwachsen, z.B. ein sogenannter Stud mit 2 bis 5 Mikrometern Dicke oder mit einer Dicke im Bereich von 5 Mikrometern bis 100 Mikrometern, insbesondere mit einer Dicke größer 40 Mikrometern. Es folgt das Abscheiden der Lot-Metallisierung mit Dicken von bis zu 50 Mikrometern oder bis zu 150 Mikrometern.

Nach dem Lackentfernen müssen die Barrierschicht und die Hilfsschicht wieder entfernt werden. Hier kommen nasschemische Verfahren zum Einsatz. Beim Nassätzen entstehen durch die erläuterte Vorgehensweise keine unerwünschten Unterätzungen und keine Korrosion, so dass die Lotkugel weiterhin gut an der Waferoberfläche haftet.

Insbesondere bei Hilfsschichten aus Kupfer werden die Bildung von starken intermetallischen Phasen von Kupfer mit Zinn und das damit verbundene vollständige Auflösen von Kupfer im Zinn-Silber-Lot sowie die Bildung von Poren an der Grenzflächen zur Barriere vermieden. Ein Ablösen der Bumps und ein Ausfall des Systems werden wirksam verhindert.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Galvanisieren,

mit den Schritten:

5 Aufbringen einer elektrisch leitfähigen Grundsicht (22) auf ein Substrat (12),

Aufbringen einer im Vergleich zu der Grundsicht (22) besser elektrisch leitenden Hilfsschicht (24) nach dem Aufbringen der Grundsicht (22),

10 Aufbringen einer Maskenschicht (26) nach dem Aufbringen der Hilfsschicht (24),

Erzeugen einer Maske mit mindestens einer Maskenöffnung (28) aus der Maskenschicht (26),

15 Strukturieren der Hilfsschicht (24) unter Verwendung der Maske, wobei die Grundsicht (22) nicht oder nicht vollständig gemäß der Maske strukturiert wird,

Galvanisieren mindestens einer Schicht (50, 52) in der Maskenöffnung (28) nach dem Strukturieren der Hilfsschicht (24).

20 2. Verfahren nach Anspruch 1, g e k e n n z e i c h n e t durch die Schritte:

Galvanisieren mit einer Stromdichte in einer Anfangsphase,

Galvanisieren mit einer im Vergleich zu der Stromdichte während der Anfangsphase höheren Stromdichte in einer der An-

25 fangsphase folgenden Hauptphase.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e - k e n n z e i c h n e t , dass die Stromdichte in der Anfangsphase einen Wert kleiner als 50 Prozent der Stromdichte in

30 der Hauptphase hat,

und/oder dass die Anfangsphase länger als fünf Sekunden

und/oder kürzer als fünf Minuten ist,

und/oder dass die Stromdichte in der Hauptphase größer als

0,2 Ampere pro Quadratdezimeter und/oder kleiner als 10 Ampe-

35 re pro Quadratdezimeter ist.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die Schritte:

Aufbringen einer Isolierschicht (18) vor dem Aufbringen der Grundsicht (22),

- 5 Strukturieren der Isolierschicht (18) unter Erzeugen einer Kontaktöffnung (20) vor dem Aufbringen der Grundsicht (22), und vorzugsweise Aufbringen eines Teils der Grundsicht (22) in der Kontaktöffnung (20).

- 10 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundsicht (22) eine Barrierschicht gegen Kupferdiffusion ist, und dass die Hilfsschicht (24) Kupfer enthält oder aus Kupfer besteht.

15

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die Schritte:

Galvanisieren einer Sockelschicht (50),

Galvanisieren einer Deckschicht (52) nach dem Galvanisieren

- 20 der Sockelschicht (50), wobei die Sockelschicht (50) aus einem anderen Material besteht als die Deckschicht (52).

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Material der Sockelschicht (50)

- 25 einen Schmelzpunkt größer 500 Grad Celsius hat, und dass das Material der Deckschicht (52) einen Schmelzpunkt kleiner 400 Grad Celsius hat.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da -

- 30 durch gekennzeichnet, dass das Strukturieren der Hilfsschicht mit einem galvanischen Verfahren durchgeführt wird, vorzugsweise in derselben Anlage wie das Galvanisieren der Schicht (50, 52) in der Maskenöffnung (28).

- 35 9. Kontaktvorsprungsanordnung (10), die in der folgenden Reihenfolge mit zunehmenden Abstand zu einem Substrat (12) eines integrierten Schaltkreises enthält:

eine elektrisch leitfähige Leitbahn (16) oder Anschlussplatte,

eine elektrisch leitfähige Grundsicht (22),

angrenzend an die Grundsicht (22) eine kupferfreie Sockel-

5 schicht (50) aus einem Material mit einer Schmelztemperatur größer 500 Grad Celsius,

eine elektrisch leitfähige Lotmaterialsicht (52) mit einem Schmelzpunkt kleiner 400 Grad Celsius.

10 10. Kontaktvorsprungsanordnung (10) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Sockelschicht (50) aus Nickel oder Nickelphosphor besteht, oder mindestens 60 Atomprozent Nickel enthält.

15 11. Kontaktvorsprungsanordnung (10) nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass an der Grenze zwischen Sockelschicht (50) und Lotmaterialsicht (52) eine Grenzsicht aus binären oder mehrphasigen Verbindungen vorhanden ist, insbesondere aus einer ternären Verbindung.

20

12. Kontaktvorsprungsanordnung (10) nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitbahn (16) oder die Anschlussplatte mindestens 80 Atomprozent Aluminium enthält, oder dass die Leitbahn (16) oder die

25 Anschlussplatte mehr als 50 Atomprozent Kupfer enthält, und/oder dass die Lotmaterialsicht (52) aus einer Zinnlegierung besteht, insbesondere aus einer Zinn-Silber-Legierung oder einer Zinn-Blei-Legierung oder einer Zinn-Silber-Kupfer-Legierung oder einer Zinn-Silber-Wismut-Legierung, oder eine

30 Zinnlegierung enthält, insbesondere eine Zinn-Silber-Legierung oder eine Zinn-Blei-Legierung oder eine Zinn-Silber-Kupfer-Legierung oder eine Zinn-Silber-Wismut-Legierung,

und/oder dass die Grundsicht (22) eine Diffusionssperre für

35 Kupfer bildet,

und/oder dass die Grundschrift (22) aus Titanwolfram besteht oder Titanwolfram enthält, wobei der Titananteil vorzugsweise kleiner als 20 Atomprozent ist,

5 und/oder dass die Grundschrift einen Schichtstapel aus mehreren Teilschichten enthält, wobei der Schichtstapel mindestens eine der folgenden Schichten enthält, eine Titanschicht, eine Tantalschicht, eine Titannitridschicht, eine Tantalnitridschicht, eine Wolframschicht, eine Titanwolframschicht oder eine Titanwolframnitridschicht.

10

13. Kontaktvorsprungsanordnung (10) nach einem der Ansprüche 9 bis 12, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Grundschrift (22) an die Leitbahn (16) oder die Anschlussplatte angrenzt,

15 und/oder dass die Sockelschicht (50) an die Lotmaterialschicht (52) angrenzt.

14. Kontaktvorsprungsanordnung (10) nach einem der Ansprüche 9 bis 13, g e k e n n z e i c h n e t d u r c h eine elektrisch
20 isolierende Schicht (18) mit einer Aussparung (20), in der zumindest eine Teil der Grundschrift (22) und ein Teil der Sockelschicht (50) angeordnet sind.

FIG 1A

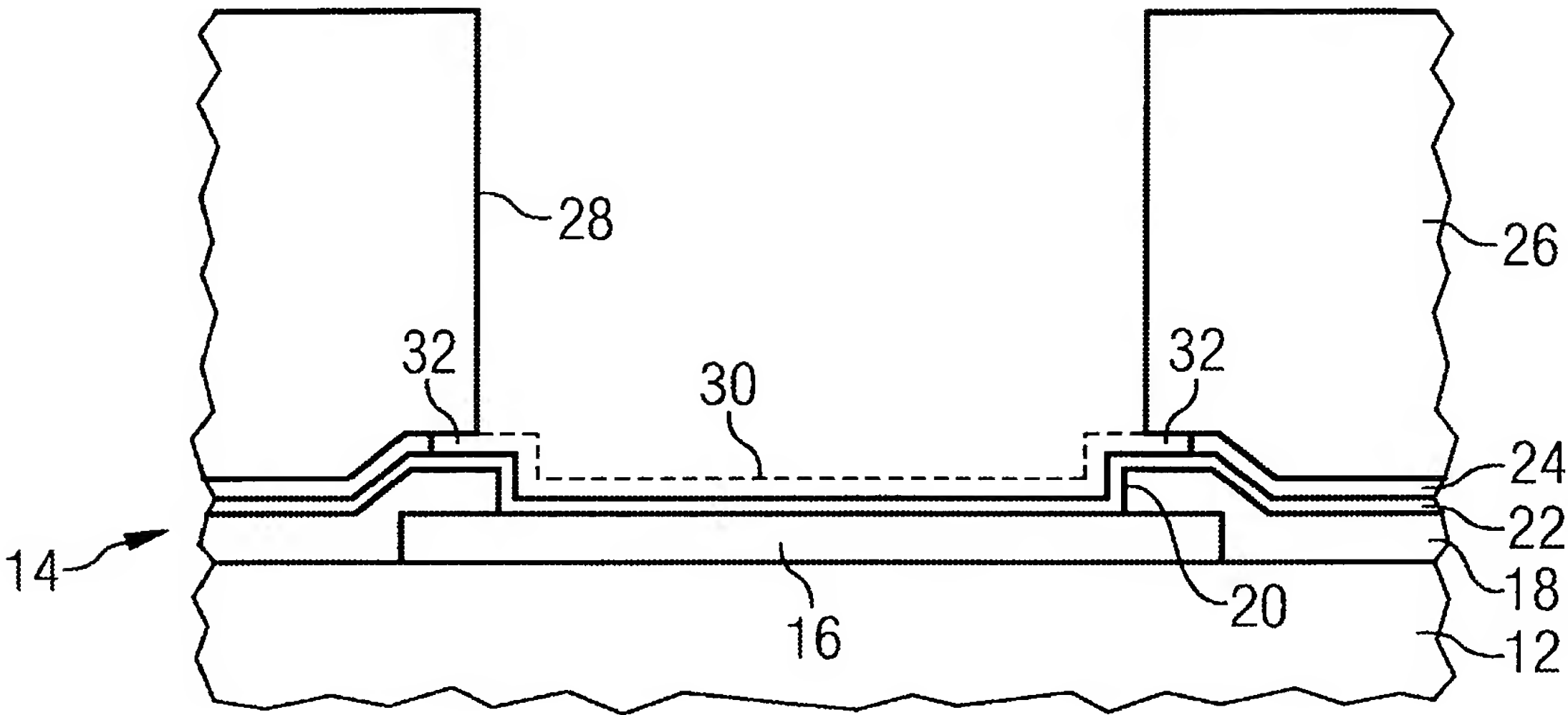


FIG 1B

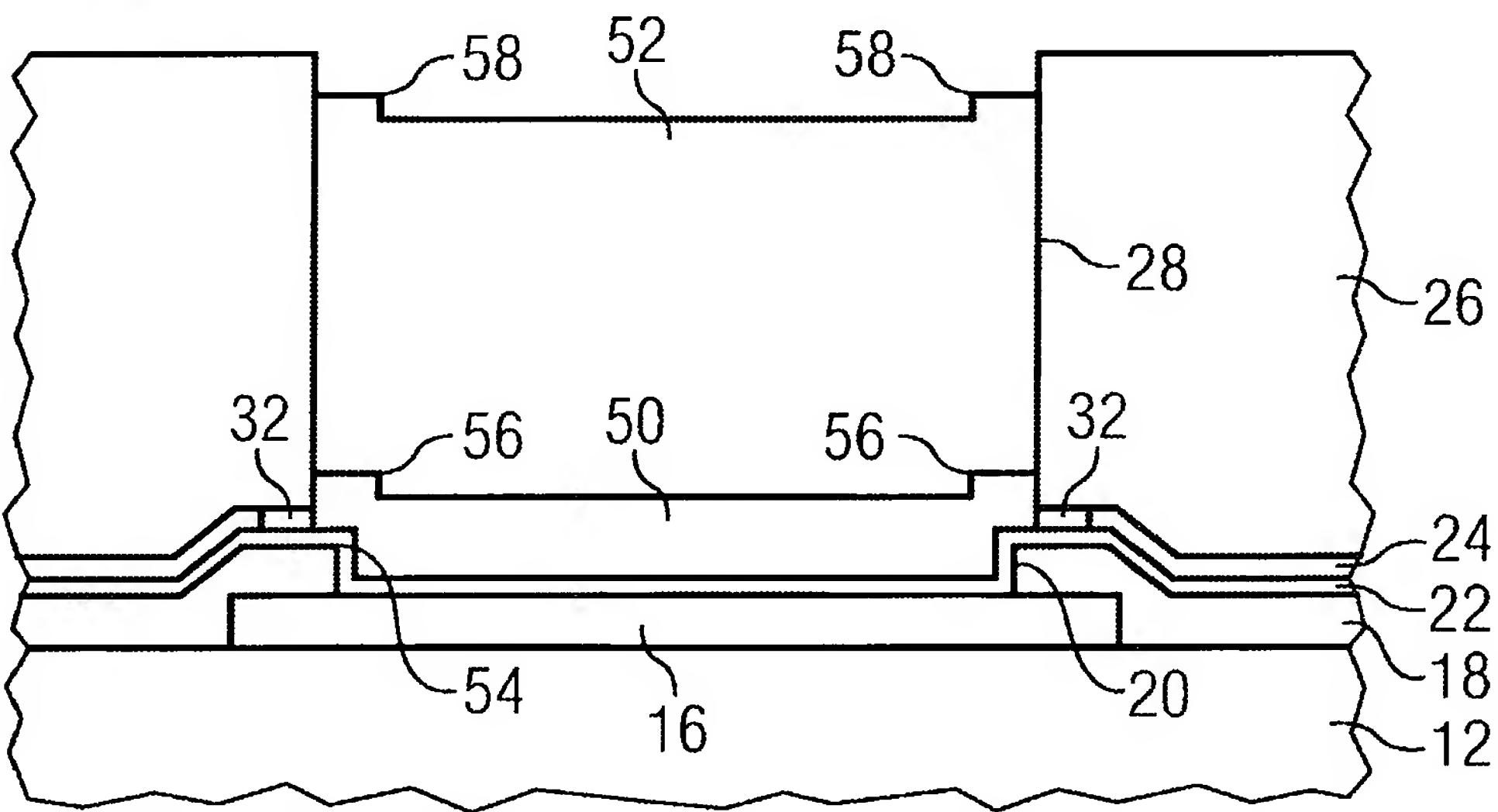


FIG 1C

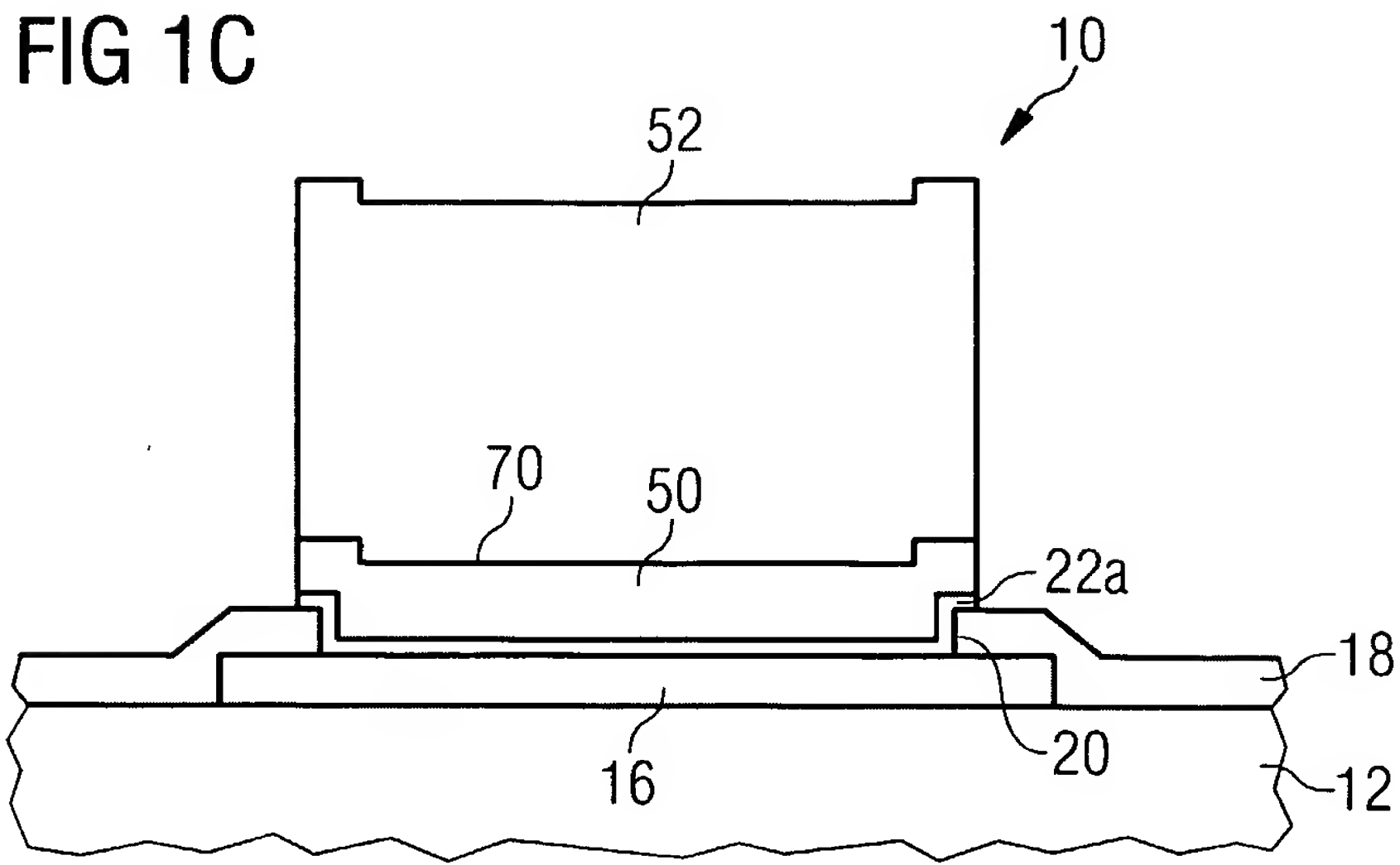
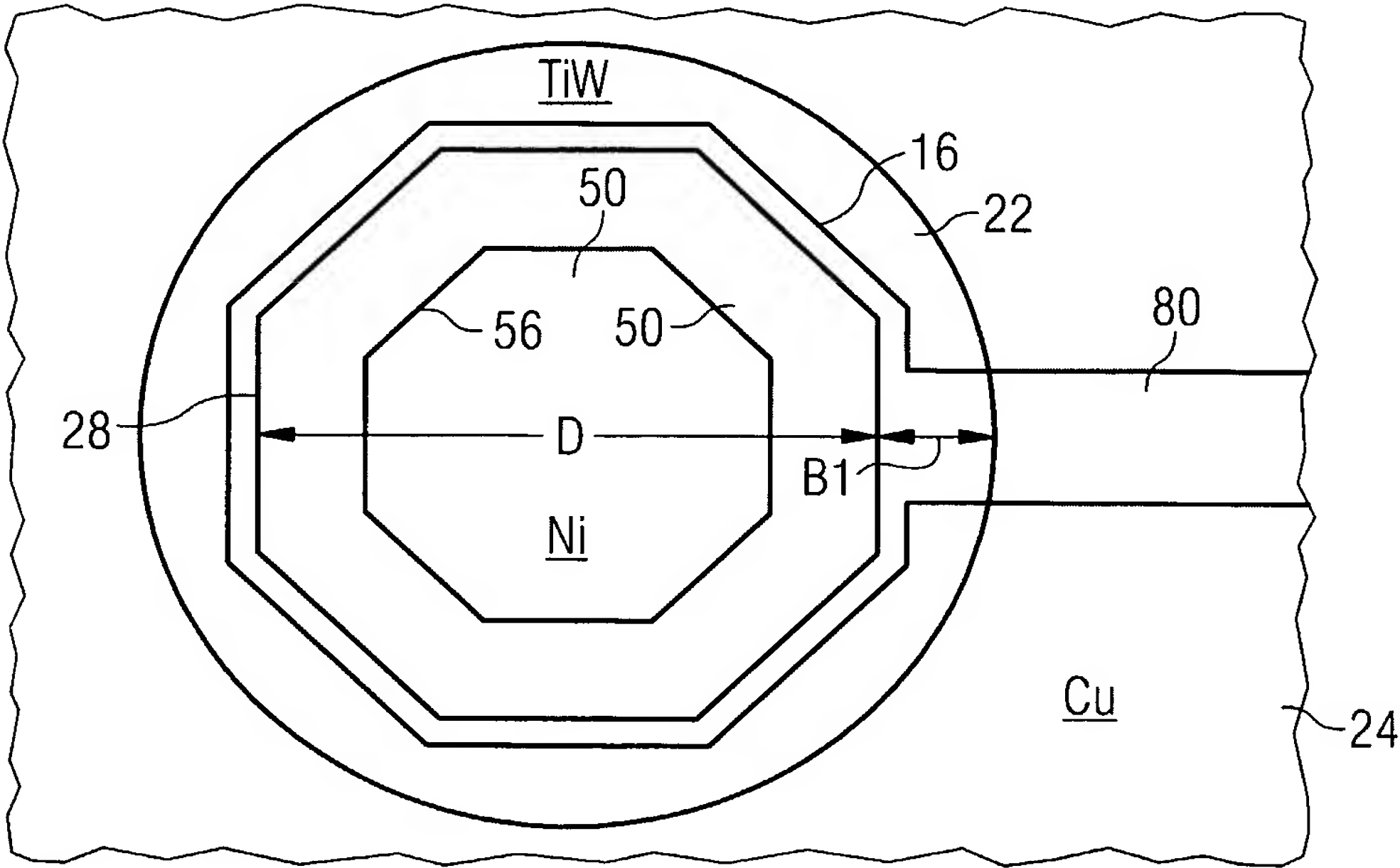


FIG 2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2004/052999

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H01L21/60 H01L21/288

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 261 799 A (FUJITSU LIMITED) 30 March 1988 (1988-03-30) column 3, line 1 - line 15 column 4, line 28 - column 5, line 8; figures 1d,4a-c,5	1,4-7
X	----- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 005, no. 179 (E-082), 17 November 1981 (1981-11-17) & JP 56 105653 A (SEIKO INSTR & ELECTRONICS LTD), 22 August 1981 (1981-08-22) abstract; figure ----- -/--	1,4,5



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

22 February 2005

Date of mailing of the international search report

01/03/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Micke, K

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2004/052999

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>WO 03/044246 A (HONEYWELL INTERNATIONAL INC; WHITE, TAMARA, L; DEAN, NANCY, F; WEISER,) 30 May 2003 (2003-05-30) page 2, paragraph 7 - page 3, paragraph 11 page 4, paragraph 21 page 5, paragraph 25 - paragraph 27 page 7, paragraph 36 page 10, paragraph 49 - page 11, paragraph 53; figure 2</p>	9-14
A	<p>----- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 533 (E-1005), 22 November 1990 (1990-11-22) & JP 02 224336 A (NEC CORP), 6 September 1990 (1990-09-06) abstract; figures 1,2 -----</p>	1-8

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/052999

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0261799	A	30-03-1988	JP 63056941 A	11-03-1988
			JP 1634971 C	20-01-1992
			JP 2057702 B	05-12-1990
			JP 63058858 A	14-03-1988
			DE 3777047 D1	09-04-1992
			EP 0261799 A1	30-03-1988
			KR 9006511 B1	03-09-1990
			US 4742023 A	03-05-1988

JP 56105653	A	22-08-1981	NONE	

WO 03044246	A	30-05-2003	WO 03044246 A1	30-05-2003
			AU 2002241512 A1	10-06-2003
			EP 1444385 A1	11-08-2004
			US 2005000821 A1	06-01-2005

JP 02224336	A	06-09-1990	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/052999

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H01L21/60 H01L21/288

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 261 799 A (FUJITSU LIMITED) 30. März 1988 (1988-03-30) Spalte 3, Zeile 1 - Zeile 15 Spalte 4, Zeile 28 - Spalte 5, Zeile 8; Abbildungen 1d, 4a-c, 5	1, 4-7
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 005, Nr. 179 (E-082), 17. November 1981 (1981-11-17) & JP 56 105653 A (SEIKO INSTR & ELECTRONICS LTD), 22. August 1981 (1981-08-22) Zusammenfassung; Abbildung	1, 4, 5

-/--

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

22. Februar 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

01/03/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Micke, K

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 03/044246 A (HONEYWELL INTERNATIONAL INC; WHITE, TAMARA, L; DEAN, NANCY, F; WEISER,) 30. Mai 2003 (2003-05-30) Seite 2, Absatz 7 - Seite 3, Absatz 11 Seite 4, Absatz 21 Seite 5, Absatz 25 - Absatz 27 Seite 7, Absatz 36 Seite 10, Absatz 49 - Seite 11, Absatz 53; Abbildung 2	9-14
A	----- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 014, Nr. 533 (E-1005), 22. November 1990 (1990-11-22) & JP 02 224336 A (NEC CORP), 6. September 1990 (1990-09-06) Zusammenfassung; Abbildungen 1,2 -----	1-8

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/052999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0261799	A	30-03-1988	JP 63056941 A 11-03-1988
		JP 1634971 C 20-01-1992	
		JP 2057702 B 05-12-1990	
		JP 63058858 A 14-03-1988	
		DE 3777047 D1 09-04-1992	
		EP 0261799 A1 30-03-1988	
		KR 9006511 B1 03-09-1990	
		US 4742023 A 03-05-1988	
JP 56105653	A	22-08-1981	KEINE
WO 03044246	A	30-05-2003	WO 03044246 A1 30-05-2003
		AU 2002241512 A1 10-06-2003	
		EP 1444385 A1 11-08-2004	
		US 2005000821 A1 06-01-2005	
JP 02224336	A	06-09-1990	KEINE